

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第1区分
 【発行日】平成19年6月21日(2007.6.21)

【公開番号】特開2006-120525(P2006-120525A)
 【公開日】平成18年5月11日(2006.5.11)
 【年通号数】公開・登録公報2006-018
 【出願番号】特願2004-308505(P2004-308505)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 6/10 (2006.01)

F 1 6 C 13/00 (2006.01)

G 0 3 G 15/20 (2006.01)

H 0 5 B 6/14 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 6/10 3 7 1

F 1 6 C 13/00 C

G 0 3 G 15/20 5 0 5

G 0 3 G 15/20 5 1 5

H 0 5 B 6/14

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月7日(2007.5.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

磁束発生手段と、前記磁束発生手段からの磁束により発熱する発熱部材と、を有し、前記発熱部材の発熱により被加熱材を加熱する加熱装置において、

前記発熱部材および前記磁束発生手段を支持する支持部材を、前記発熱部材は回転可能に、前記磁束発生手段は固定して、かつ、前記発熱部材と前記磁束発生手段の中心軸を同軸上にして支持するように構成したことを特徴とする加熱装置。

【請求項2】

前記支持部材を、前記発熱部材および前記磁束発生手段の長手方向の一端側を支持する支持部材と、これとは独立して、他端側を支持する支持部材とで構成したことを特徴とする請求項1に記載の加熱装置。

【請求項3】

前記支持部材を、前記発熱部材の支持部を具備させた第1支持部材と、これとは別体で、前記磁束発生手段の支持部を具備させた第2支持部材との二部材で構成し、前記第1支持部材の前記支持部と前記第2支持部材の前記支持部を位置決め補助手段を用いて略同軸に位置決め状態にして前記第1支持部材と前記第2支持部材とを一体に結合にして構成したことを特徴とする請求項1 又は 2に記載の加熱装置。

【請求項4】

前記発熱部材は、円筒状の金属ローラであることを特徴とする請求項1 から 3の何れかに記載の加熱装置。

【請求項5】

前記磁束発生手段は、少なくとも、励磁コイルと、前記励磁コイルを保持するホルダーを有することを特徴とする請求項1 から 4の何れかに記載の加熱装置。

【請求項 6】

前記磁束発生手段は、その外側において磁束発生手段の中心軸と同軸に回転移動可能で、前記発熱部材への作用磁束を調整する磁束調整部材を有することを特徴とする請求項 1 から 5 の何れかに記載の加熱装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0024】

この定着装置は、磁束により発熱する発熱部材（誘導発熱部材）としての定着ローラと、磁束発生手段（加熱手段）としての励磁コイルアセンブリの相対位置精度の向上を目的に、定着ローラを回転可能に支持する支持部材の位置決め手段と励磁コイルアセンブリの位置決め手段を含む位置決め部材により、定着ローラと励磁コイルアセンブリを同軸上に支持可能に構成された定着装置である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0025】

1 は誘導発熱部材としての定着ローラである。鉄・ニッケル・SUS430などの誘導発熱体（導電性磁性材）から形成された、肉厚が例えば0.1mm～1.5mm程度の円筒状の金属ローラである。一般に、その外周表面に、フッ素樹脂等の離型層、あるいは弾性層と離型層等を形成して用いられる。鉄など強磁性の金属（透磁率の高い金属）を使うことで、磁束発生手段から発生する磁束を金属内部により多く拘束させることができる。すなわち、磁束密度を高くすることができることにより効率的に金属表面に渦電流を発生させられる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0029】

3 は磁束発生手段としての励磁コイルアセンブリである。この励磁コイルアセンブリ 3 は上記の円筒状の定着ローラ 1 の内空部に挿入して配設してある。励磁コイルアセンブリ 3 は、励磁コイル（以下、コイルと略記する）4、横断面 T 字型に配設された磁性体コア（以下、コアと略記する）5a・5b、上記のコイル 4 とコア 5a・5b を内蔵させて保持させたホルダー 6、このホルダー 6 の外側にホルダー 6 と略同軸に回転移動可能に配設した磁束調整部材（磁束遮蔽部材、シャッター）7、等の組み立て体である。図 8 はこの励磁コイルアセンブリ 3 と磁束調整部材移動手段 M2・28・G4・G5 の外観斜視図である。図 9 はホルダー 6 と磁束調整部材 7 の分解斜視図である。図 10 はホルダー 6 の内部の分解斜視図である。